

PIFOC® Objektivscanner mit hoher Dynamik

NANOMETER- AUFLÖSUNG FÜR SCHWERE OBJEKTIVE



P-725KHDS

- + Stellweg 400 µm
- + Resonanzfrequenz 120 Hz mit 400 g Last
- + Einschwingzeit 20 ms mit 400 g Last
- + QuickLock- Gewindeadapter bis M32

PIFOC® Objektivpositionierer

1 Achse. Reibungsfreie Festkörpergelenke. Kapazitiver Positionssensor für bestmögliche Stabilität und Linearität. QuickLock- Adapter für einfache Installation

PICMA® Hochleistungsantrieb

Piezokeramische Aktoren mit vollkeramischer Isolation. Höhere Lebensdauer, unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Betriebstemperaturen bis 80 °C

Einsatzgebiete

Mikroskopie, konfokale Mikroskopie, 3D- Imaging, Screening, Autofokussysteme, Oberflächenanalyse. Ideal für Multiphotonenmikroskopie aufgrund der hohen Dynamik bei großen Lasten

Spezifikationen

Vorläufige Daten	P-725KHDS	Einheit
Aktive Achsen	Z	
Bewegung und Positionieren		
Integrierter Sensor	Kapazitiv	
Stellweg, geregelt	400	µm
Auflösung, geregelt	2,5	nm
Linearitätsabweichung in X, Y	0,06	%
Mechanische Eigenschaften		
Steifigkeit	0,35	N/ µm
Resonanzfrequenz unbelastet in X	330	Hz
Resonanzfrequenz in X, belastet, 100 g	230	Hz
Resonanzfrequenz in X, belastet, 400 g	120	Hz
Belastbarkeit	10	N
Antriebseigenschaften		
Piezokeramik	PICMA® P-887	
Elektrische Kapazität in X, Y	6,4	µF
Anschlüsse und Umgebung		
Betriebstemperaturbereich	10 bis 50	°C
Material	Aluminium	
Kabellänge	1,5	m

Stecker	D- Sub- Spezial, 1 Kanal
Empfohlener Controller	E-709.CHG

Sonderausführungen auf Anfrage.

Bestellinformation

P-725KHDS

PIFOC[®] Piezo- Nanofokussystem mit hoher Steifigkeit, 400 µm, kapazitive Sensoren, D- Sub- Stecker, für QuickLock- Adapter

Sonderausführungen auf Anfrage.

Controller / Treiber / Verstärker

[E-709.CHG Digitaler 1- Kanal- Piezocontroller](#)

Zeichnungen / Bilder

P-725KHDS,
Abmessungen in mm

